#9-1PD 2/5/02

Attorney Docket No. 826.1768

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Yoichi OIKAWA

Application No.:

Group Art Unit:

Filed: November 7, 2001

Examiner:

For: OPTICAL SWITCH FOR COMPENSATING FOR DEGRADATION OF OPTICAL-COUPLING CHARACTERISTIC

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN

APPLICATION IN ACCORDANCE

WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s) herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2001-211208

Filed: July 11, 2001

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

Date: November 7, 2001

By: James D. Halsey, Jr.

Registration No. 22,729

700 11th Street, N.W., Ste. 500 Washington, D.C. 20001 (202) 434-1500

109/986027 09/986027 11/07/01

PATANT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: July 11, 2001

Application Number: Patent Application

No. 2001-211208

Applicant(s): FUJITSU LIMITED

August 31, 2001

Commissioner,

Patent Office Kozo OIKAWA

Certificate No. 2001-3078566

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 7月11日

出願番号 Application Number:

特願2001-211208

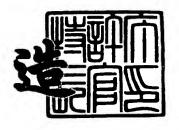
出 願 Applicant(s):

富士通株式会社

2001年 8月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

0150375

【提出日】

平成13年 7月11日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 26/08

G02F 1/29

【発明の名称】

光スイッチ

【請求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】

北海道札幌市北区北七条西四丁目3番地1 富士通東日

本ディジタル・テクノロジ株式会社内

【氏名】

及川 陽一

【特許出願人】

【識別番号】

000005223

【氏名又は名称】

富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】

100074099

【住所又は居所】

東京都千代田区二番町8番地20 二番町ビル3F

【弁理士】

【氏名又は名称】

大菅 義之

【電話番号】

03-3238-0031

【選任した代理人】

【識別番号】 100067987

【住所又は居所】

神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7-25-28-503

【弁理士】

【氏名又は名称】

久木元 彰

【電話番号】

045-573-3683

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012542

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9705047

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】

光スイッチ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 印加電圧に応じて傾き角度が変化するミラーと、

前記ミラーに前記印加電圧を印加するドライバ手段と、

所定周波数の付加信号を発生する発振手段と、

前記印加電圧に前記付加信号を重畳する重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記所定周波数の信号成分を検出する検出手段 と、

検出された信号成分に基づいて前記印加電圧を制御する制御手段と を備えることを特徴とする光スイッチ。

【請求項2】 前記印加電圧に関する情報と前記光スイッチの光結合効率に関する情報のうち少なくとも一方を記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された情報を所定の通知先に通知する通知手段とをさらに備えることを特徴とする請求項1記載の光スイッチ。

【請求項3】 前記発振手段は、前記ミラーの機械的共振周波数より高い周波数の付加信号を発生することを特徴とする請求項1記載の光スイッチ。

【請求項4】 第1の印加電圧に応じて第1の方向の傾き角度が変化し、第2の印加電圧に応じて第2の方向の傾き角度が変化するミラーと、

前記ミラーに前記第1の印加電圧を印加する第1のドライバ手段と、

前記ミラーに前記第2の印加電圧を印加する第2のドライバ手段と、

第1の周波数の第1の付加信号を発生する第1の発振手段と、

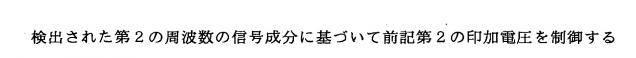
第2の周波数の第2の付加信号を発生する第2の発振手段と、

前記第1の印加電圧に前記第1の付加信号を重畳する第1の重畳手段と、

前記第2の印加電圧に前記第2の付加信号を重畳する第2の重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記第1および第2の周波数の信号成分を検出 する検出手段と、

検出された第1の周波数の信号成分に基づいて前記第1の印加電圧を制御する 第1の制御手段と、



を備えることを特徴とする光スイッチ。

【請求項5】 印加電圧に応じて傾き角度が変化するミラーを有する光スイッチのための制御装置であって、

前記ミラーに前記印加電圧を印加するドライバ手段と、

所定周波数の付加信号を発生する発振手段と、

前記印加電圧に前記付加信号を重畳する重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記所定周波数の信号成分を検出する検出手段 と、

検出された信号成分に基づいて前記印加電圧を制御する制御手段と を備えることを特徴とする制御装置。

【発明の詳細な説明】

第2の制御手段と

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、フォトニックネットワークを構成するノード装置における光スイッチに関する。

[0002]

【従来の技術】

光波長多重伝送(Wavelength Division Multiplexing, WDM)システムは、 伝送容量を飛躍的に増大できる通信システムとして、開発および実用化が進められている。WDMシステム同士を接続し、広大なフォトニックネットワークを構築するために、各装置間をループ状に接続するリング型ネットワークが検討されている。このネットワークでは、ネットワークの規模が大きくなると、ループ内での伝送データ量が膨大になることから、メッシュ状に接続するメッシュ型ネットワークも精力的に検討されている。

[0003]

このようなネットワーク構築のキーテクノロジーは、多数の入出力ファイバを スイッチングできる大規模な光スイッチである。リング型ネットワークやpoint-



to-pointのシステムにおいては、ノード内での低次群の信号を取り出す際に、電気スイッチが用いられている。これを光スイッチに置き換えることにより、このノード内のコストを削減することができる。したがって、大規模光スイッチの実現は、様々な形態のネットワークにおいて重要な課題である。

[0004]

現在、実用化されている光スイッチは、主に導波路型の小規模スイッチであり、入出力ファイバアレイとスイッチ素子から構成されている。スイッチ素子を大規模化するには、スイッチセル自身の歩留まりを上げる必要があるが、製造工程における寸法トレランスが狭いので難しい。

[0005]

また、光の損失要因には、スイッチセル部分での損失と、入出力ファイバとの接続部分での損失があるが、これらを低減させることは難しい。このため、スイッチ素子を大規模化するには、製造工程の改良による歩留まり向上のみならず、素子性能を格段に向上させる必要がある。

[0006]

一方、伝統的な技術として、光を空間的にスイッチングする構成が考えられる。例えば、光路変更素子として反射ミラーを用いれば、導波路スイッチで問題になるon/off比、クロストーク等の性能については、まったく問題がない。しかしながら、スイッチの体積が大きくなるので、大きさの観点から大規模化が困難である。

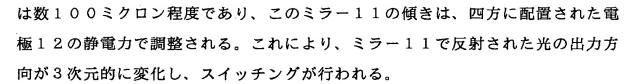
[0007]

この状況を打破するために、最近、この空間スイッチを半導体製造技術で小さく作製する技術が開発されている。この技術は、マイクロ・エレクトロ・メカニカルシステム(Micro Electro Mechanical System, MEMS)と呼ばれ、特に光分野に適用したものは、光MEMSとも言われている。この技術によれば、半導体製造技術を用いて微小ミラーが基板上に作製され、このミラーを静電力により3次元的に傾けることで、所要の入出力間が空間的に結合される。

[0008]

図13は、MEMSの微小ミラーの例を示している。円形ミラー11のサイズ





[0009]

この空間スイッチは、ミラーを用いているので、スイッチング性能は導波路型よりも優れており、そのサイズも導波路型と同じ程度に小さい。このような可動ミラー1つで、図14に示すように、1入力n出力のスイッチングが空間的に行われるので、このスイッチは3次元MEMSスイッチと呼ばれている。

[0010]

図14において、可動ミラー13は、1本の入力ファイバ14からの光をn本の出力ファイバ15のいずれかに出力することができる。この場合、ミラー変位パラメータは、x軸の回りのミラーの回転角を表すθxと、y軸の回りのミラーの回転角を表すθyの2つである。あらかじめ求められている電圧Vx、Vyを電極に印加することにより、ミラーの傾き角度が所定量だけ変位し、スイッチングが行われる。

[0011]

この可動ミラーの角度変位量が大きくとれない場合、図15に示すように、可動ミラーを2段にする構成も考えられている。図15において、入力ファイバ14からの光は、1段目の可動ミラー16により反射されて、固定ミラー17に向かい、固定ミラー17により反射された後、2段目の可動ミラー18に向かう。そして、可動ミラー18により反射されて、n本の出力ファイバ15のいずれかから出力される。この場合、ミラー変位パラメータは、各可動ミラーについてθxとθyの2つであるから、合わせて4個となる。

[0012]

n入力n出力のスイッチを構成する場合、1段型ではn個の可動ミラーが用いられ、2段型では2n個の可動ミラーが用いられる。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した従来の光MEMSスイッチには、次のような問題があ

る。

[0014]

スイッチに用いられるミラーの剛性は、雰囲気温度や湿度により変化する。これに起因して、ミラーの電圧 - 回転角度特性が変化してしまい、スイッチング時の光結合特性が劣化することが考えられる。光結合特性の劣化には、光結合効率の低下、他のチャネルへのクロストーク等が含まれる。

[0015]

また、ミラーの機械的振動等によってもスイッチング時の光結合特性が劣化することが考えられる。このように様々な要因で発生するであろう光結合特性の劣化を、なんらかの形で補償することが不可欠である。

[0016]

本発明の課題は、フォトニックネットワークを構成するノード装置において、 光結合特性の劣化を補償する光MEMSスイッチを提供することである。

[0017]

【課題を解決するための手段】

図1は、本発明の光スイッチの原理図である。図1の光スイッチは、印加電圧 に応じて傾き角度が変化するミラー20、ドライバ手段21、発振手段22、重 畳手段23、検出手段24、および制御手段25を備える。

[0018]

ドライバ手段21は、ミラー20に印加電圧を印加し、発振手段22は、所定 周波数の付加信号を発生し、重畳手段23は、印加電圧に付加信号を重畳する。 検出手段24は、ミラー20で反射された光から上記所定周波数の信号成分を検 出し、制御手段25は、検出された信号成分に基づいて印加電圧を制御する。

[0019]

ミラー20は、例えば、MEMSの微小ミラーに対応し、光を反射して光スイッチからの出力光を生成する。重畳手段23は、ドライバ手段21から出力された印加電圧に、発振手段22が生成した付加信号を重畳する。そして、付加信号が重畳された印加電圧がミラー20に印加され、ミラー20を駆動する。

[0020]

ミラー20で反射された光は、付加信号の周波数の信号成分を含み、この信号成分は、検出手段24により検出されて、制御手段25に出力される。制御手段25は、この信号成分の値に応じて印加電圧を増減するように、ドライバ手段21を制御する。

[0021]

このような光スイッチによれば、反射光に現れる付加信号の周波数成分は、光結合特性の変動に応じて変化する。このため、この成分の変化に応じて印加電圧 を増減することで、光結合特性の変動を補償することが可能になる。

[0022]

図1のドライバ手段21は、例えば、後述する図5のドライバ回路46、後述する図7のドライバ/制御回路63、64、および後述する図9のドライバ/制御回路103、104、113、114に対応する。

[0023]

図1の発振手段22は、例えば、図5の低周波発振回路48、図7の低周波発振回路65、66、および図9の低周波発振回路105、106、115、116に対応する。

[0024]

図1の重畳手段23は、例えば、図5の低周波重畳回路45、図7の低周波重畳回路61、62、および図9の低周波重畳回路101、102、111、11 2に対応する。

[0025]

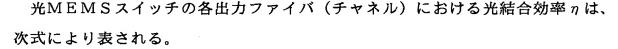
図1の検出手段24は、例えば、図5の低周波検出回路44に対応する。また、図1の制御手段25は、例えば、図5の制御回路47、図7のドライバ/制御回路63、64、図9のドライバ/制御回路103、104、113、114、および後述する図10のデジタル制御回路121、外部記憶回路122に対応する。

[0026]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。





[0027]

$$\eta = e \times p \quad (-\pi 2 \quad \theta 2 \quad w 2 / \lambda 2) \tag{1}$$

ここで、θはミラーで反射された光ビームと出力ファイバの角度のずれを表し、ミラーの回転角度のずれに比例する。また、wはビーム径を表し、λは光の波長を表す。

[0028]

また、ミラーの回転角度と電極への印加電圧の関係はほぼ線形であるので、光結合と回転角度の関係は、光結合効率 η とMEMS駆動電圧(印加電圧)Vの特性(η -V特性)で置き換えることができる。この η -V特性は、(1)式の η - θ 特性と同様に、一般に単峰性の非線形な特性となる。そこで、各出力ファイバに対して、この光結合効率がピークとなるように、所定の電圧が印加される。

[0029]

図2は、ある出力ファイバにおけるn-V特性の例を示している。図2において、nの単位はデシベル(dB)であり、V=Vaでnがピーク値をとる。したがって、入力光をこの出力ファイバへスイッチングする場合、Vaが電極に印加される。さらに、本実施形態では、n-V特性のドリフト(ずれ)を検出し、それによる出力光の劣化を補償するために、Vaに低周波信号Vc · c o s (ω t) を付加信号として重畳する。

[0030]

図3は、印加電圧に低周波信号を重畳した場合のドリフトと出力光の関係を示している。まず、曲線31で示されるように、n-V特性にドリフトがない状態では、低周波信号が重畳された印加電圧33($Va+Vc\cdot cos(\omega t)$)に対して、出力光の信号34には低周波成分は現れない。

[0031]

しかし、η-V特性が印加電圧の正の方向(右方向)にドリフトして曲線32



のようになると、出力光の信号 35 は V ma +V mc・c o s (ω t) となり、出力光のレベルが低下するとともに、印加電圧と同位相の低周波成分が重畳されて現れる。また、図 4 に示すように、η -V 特性が負の方向(左方向)にドリフトして曲線 36 のようになると、出力光の信号 37 は、V ma -V mc・c o s (ω t) となり、印加電圧と逆位相の低周波成分が現れる。

[0032]

このように、出力光に現れる低周波成分は、ドリフトの方向により位相が異なる。したがって、この低周波成分の位相を検出することで、どの方向に印加電圧をシフトさせれば、光結合効率を元の状態に戻すことができるかが分かる。正方向のドリフトの場合は、印加電圧を大きくすればよく、負方向のドリフトの場合は、印加電圧を小さくすればよい。

[0033]

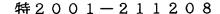
また、低周波成分の振幅Vmcの大きさは、ドリフトの大きさに応じて変化するので、これを検出することで、印加電圧をどの程度シフトさせればよいかが分かる。こうして、印加電圧に所定の周波数の信号を重畳し、出力光に現れた同じ周波数の成分を検出することで、ドリフトによる光結合特性の劣化を補償することができる。

[0034]

図5は、このような補償動作を行う光スイッチの構成図である。図5の光スイッチは、光路41、42、ミラー部43、低周波検出部44、低周波重畳回路45、ドライバ回路46、制御回路47、および低周波発振回路48から構成される。

[0035]

ミラー部43は、微小ミラーと電極を含み、光路41と42は、それぞれ、スイッチの入力光と出力光の光路に対応する。ドライバ回路46は、出力光を所定の出力ファイバに導くための所定の印加電圧を生成する。低周波発振回路48は、所定の周波数の低周波信号を発生し、低周波重畳回路45は、ドライバ回路46からの印加電圧に、低周波発振回路48からの低周波信号を重畳して、ミラー部43の電極に印加する。





低周波検出部44は、ミラーにより反射された出力光から低周波成分を検出して、制御回路47に伝達する。制御回路47は、受け取った低周波成分と低周波発振回路48の出力信号を用いて制御信号を生成し、ドライバ回路46に出力する。そして、ドライバ回路46は、制御信号に応じて印加電圧を変化させる。

[0037]

図5の光スイッチは、アナログ回路または/およびデジタル回路を用いて実現することが可能である。アナログ回路を用いた場合、例えば、図6のような回路 構成が考えられる。

[0038]

図6において、光カプラ51、フォトダイオード52、および増幅器53は、 図5の低周波検出部44に対応し、発振器55は、図5の低周波発振回路48に 対応する。また、乗算器54(同期検波器等)および低域通過フィルタ56は、 図5の制御回路47に対応し、差動増幅器57は、図5のドライバ回路46に対 応し、コイル58およびキャパシタ59は、図5の低周波重畳回路45に対応す る。

[0039]

発振器 55 は、 $Vc \cdot cos(\omega t)$ の低周波信号を発生し、差動増幅器 57 は、ドリフトなしの状態で印加電圧 Va を出力する。光力プラ 51 は、光路 42 上の出力光を分岐し、フォトダイオード 52 は、分岐された光の信号を検出する。そして、増幅器 53 は、検出された信号を増幅して乗算器 54 に入力する。

[0040]

このとき、図3に示したように、n-V特性が正方向にドリフトすると、増幅器53の出力は、 $Vma+Vmc\cdot cos(\omega t)$ となる。乗算器54は、この信号に発振器55の出力を乗算して、次のような信号VMを生成する。

[0041]

 $VM = \{Vma + Vmc \cdot cos(\omega t)\} \cdot Vc \cdot cos(\omega t)$ $= Vma \cdot Vc \cdot cos(\omega t) + Vmc \cdot Vc \cdot cos2(\omega t)$



 $= V \operatorname{ma} \cdot V \operatorname{c} \cdot \operatorname{cos} (\omega t) + 0. \quad 5 \cdot V \operatorname{mc} \cdot V \operatorname{c}$ $+ 0. \quad 5 \cdot V \operatorname{mc} \cdot V \operatorname{c} \cdot \operatorname{cos} (2 \omega t) \tag{2}$

低域通過フィルタ 5 6 は、信号 V M の交流成分を除去し、直流成分のみを通すように設計されており、0. 5 · V m c · V c の直流電圧を出力する。同様にして、図 4 に示したように、 η - V 特性が負方向にドリフトした場合は、低域通過フィルタ 5 6 から - 0. 5 · V m c · V c の直流電圧が出力される。そして、差動増幅器 5 7 は、この直流電圧を、本来印加していた V a と比較することにより、ドリフトを補償した印加電圧 V a · V a · V を生成する。

[0042]

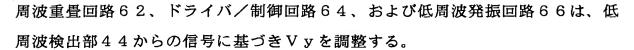
Vmcはドリフトの大きさにほぼ比例すると考えられるので、低域通過フィルタ 5 6 の出力の絶対値もまた、ドリフトの大きさに比例する。さらに、ドリフトの 方向が正方向であれば、出力値は正となり、負方向であれば負となる。したがって、この値を用いて印加電圧を制御することで、ドリフトの影響を補償することができる。

[0043]

図5の光スイッチは、ミラーの2つの回転軸のうちの一方に関する回転角度を 制御する構成になっているが、2つの回転軸に関する回転角度を同時に制御する 場合の構成は、図7のようになる。図7の光スイッチは、光路41、42、ミラ 一部43、低周波検出部44、低周波重畳回路61、62、ドライバ/制御回路 63、64、および低周波発振回路65、66から構成される。ドライバ/制御 回路63、64はともに、図5のドライバ回路46と制御回路47の機能を有す る。

[0044]





[0045]

図7の光スイッチをアナログ回路で構成すると、例えば、図8のような回路構成となる。図8において、発振器73、74は、図7の低周波発振回路65、66に対応する。また、乗算器71、低域通過フィルタ75、および差動増幅器77は、図7のドライバ/制御回路63に対応し、乗算器72、低域通過フィルタ76、および差動増幅器78は、図7のドライバ/制御回路64に対応する。また、コイル79およびキャパシタ81は、図7の低周波重畳回路61に対応し、コイル80およびキャパシタ82は、図7の低周波重畳回路62に対応する。

[0046]

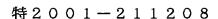
発振器 73、 74 は、それぞれ V cx · c o s (ω x t)、V cy · c o s (ω y t)の低周波信号を発生し、差動増幅器 77、 78 は、ドリフトなしの状態で、それぞれ印加電圧 V ax、V ayを出力する。

[0047]

[0048]

 $VMx = \{Vma + Vmcx \cdot cos(\omega x t) + Vmcy \cdot cos(\omega y t)\}$ $\cdot Vcx \cdot cos(\omega x t)$

- $= V \max \cdot V \operatorname{cx} \cdot \operatorname{cos} (\omega x \ t) + V \max \cdot V \operatorname{cx} \cdot \operatorname{cos} 2 (\omega x \ t)$ $+ V \max \cdot V \operatorname{cx} \cdot \operatorname{cos} (\omega x \ t) \cdot \operatorname{cos} (\omega y \ t)$
- = 0. $5 \cdot \text{Vmcx} \cdot \text{Vcx} + 0$. $5 \cdot \text{Vmcx} \cdot \text{Vcx} \cdot \text{cos} (2 \omega x \ t)$ + $\text{Vma} \cdot \text{Vcx} \cdot \text{cos} (\omega x \ t)$
 - $+0.5 \cdot \text{Vmcy} \cdot \text{Vcx} \cdot \text{cos} ((\omega x + \omega y) t)$



+0. $5 \cdot V m c y \cdot V c x \cdot c \circ s ((\omega x - \omega y) t)$

(3)

このVMxが低域通過フィルタ75を通ると、交流成分は除去され、 $0.5 \cdot V$ mcx $\cdot V$ cxの直流電圧が得られる。この値は、x軸に関する $\pi - V$ 特性のドリフトの大きさに比例すると考えられ、ドリフトの方向の正/負に応じて正/負となる。差動増幅器77は、この直流電圧をVaxと比較することにより、ドリフトを補償した印加電圧Vax+ ΔV axを生成する。

[0049]

同様にして、乗算器 7 2 は、増幅器 5 3 の出力に発振器 7 4 の出力を乗算して信号 V Myを生成し、低域通過フィルタ 7 6 は、 y 軸におけるドリフトに対応する直流電圧を出力する。そして、差動増幅器 7 8 は、この直流電圧を V ayと比較することにより、ドリフトを補償した印加電圧 V ay + Δ V ay を生成する。

[0050]

このような制御方法によれば、制御対象のパラメータが増えた場合には、パラメータの数に応じて、異なる周波数の低周波発振回路、ドライバ/制御回路、および低周波重畳回路を用意すればよいことが分かる。例えば、図15に示した2 段型ミラー構成のスイッチセルの場合、前段と後段の各ミラー部について、図7と同様の回路を設ければよい。

[0051]

図9は、このような2段型ミラー構成の光スイッチの構成図である。図9の光スイッチは、光路41、42、低周波検出部44、ミラー部91、92、低周波重畳回路101、102、111、112、ドライバ/制御回路103、104、113、114、および低周波発振回路105、106、115、116から構成される。

[0052]

この場合、前段のミラー部91のミラーのx軸、y軸のまわりの回転は、それ ぞれ、印加電圧Vx1、Vy1により制御され、後段のミラー部92のミラーのx軸 、y軸のまわりの回転は、それぞれ、印加電圧Vx2、Vy2により制御される。ま



た、低周波発振回路 105、106、115、116は、それぞれ、周波数 ω x1、 ω y1、 ω x2、 ω y2の低周波信号を発生し、低周波検出部 44 は、これらの 4 つの低周波成分を検出する。この光スイッチをアナログ回路で構成すると、図 8 と同様の回路構成となる。

[0053]

図6および図8では、アナログ回路の構成例を示したが、図5の制御回路47、図7のドライバ/制御回路63、64、および図9のドライバ/制御回路103、104、113、114にデジタル回路を付加することも可能である。

[0054]

図10は、図5の光スイッチにデジタル回路を付加した構成を示している。図10の光スイッチは、図5の構成に加えて、さらにデジタル制御回路121と外部記憶回路122を有する。

[0055]

デジタル制御回路121は、制御回路47からのアナログ電圧をデジタル信号に変換して、所定の演算により制御信号を生成し、その制御信号をアナログ電圧に変換して、ドライバ回路46に入力する。また、一定周期で印加電圧Vaと光結合効率ηの値を外部記憶回路122に書き込む。そして、外部記憶回路122は、それらのパラメータの値をパフォーマンスデータとして、ノード装置の装置制御部に通知する。

[0056]

光MEMSスイッチの状態は、これらの2つのパラメータを監視することで推測することができる。例えば、πが一定のままで、Vaのみが徐々に増加または減少していく場合、MEMSの電極部での劣化が考えられる。この場合、やがて必要印加電圧が制御範囲を超えてしまうことが予測される。

[0057]

そこで、この値の閾値(上限値・下限値)を装置制御部に設定しておき、その値に達した場合は、装置制御部がクリティカルアラームを発生させるようにする。これにより、ユーザは、電極が完全に劣化してしまう前に交換することが可能になる。逆に、ηのみが減少していく場合は、光結合部での劣化が考えられる。



この場合も、同様にアラームの閾値を決めておくことにより、劣化前に交換が可能になる。

[0058]

図11は、図10の光スイッチの回路構成の一例を示している。図11において、図6と同じ符号の部分は、図6と同じものを指している。また、通信LSI (Large-Scale Integration) 131およびRAM (Random Access Memory) 132は、図10の外部記憶回路122に対応し、演算回路133、D/A (デジタル/アナログ)変換回路134、およびA/D変換回路135は、図10のデジタル制御回路121に対応し、増幅器136は、図10のドライバ回路46に対応する。

[0059]

A/D変換回路135は、低域通過フィルタ56の出力をデジタル信号に変換して、演算回路133に出力する。演算回路133は、入力された信号に基づいて、ドリフトを補償するための印加電圧を計算し、その値に対応する信号をD/A変換回路134に出力する。D/A変換回路134は、入力された信号をアナログ信号に変換して増幅器136に出力し、増幅器136は、その信号を増幅する。

[0060]

また、演算回路 133 は、Va と η の値を計算してRAM 132 に書き込み、通信 LSI131 は、RAM132 に記憶されたデータを装置制御部に通知する。 η の代わりに、光結合損失を表すパラメータを用いてもよい。また、図 7 および図 9 のドライバ/制御回路にデジタル回路を付加した場合も、図 1 0 の構成と同様である。

[0061]

ところで、光スイッチに用いられるミラーは、可動ミラーであるため、図12 に示すように、機械的な共振振動を起こす可能性がある。可動ミラーのモデルと して完全にフリーな円板を用いると、その共振周波数 f r は、次式で表される。

[0062]



 $f r = (\lambda 2 \cdot h/2/\pi/a2) \cdot ((E/3/(1-V2)/\rho) 0.5)$

(4)

ここで、 λ 、h、a、E、V、および ρ は、それぞれ、モードパラメータ、厚み、半径、ヤング率、ポアソン比、および材料密度を表す。例えば、 $\lambda=3$. 2 (基本モードの場合)、 $h=1~\mu$ m、 $a=1~5~0~\mu$ m、 $E=1~5~0~\times1~09~N/m^2$ 、V=約0. 3、 $\rho=2~\times1~03~k~g/m^3$ (Si (シリコン)の場合)とすると、f r=2~6~0~KHz (周期: $4~\mu$ sec)と見積もられる。実際のミラーは4 箇所を固定されているので、その共振周波数は、このオーダよりは高くなり、MHzのオーダになるものと考えられる。

[0063]

この共振が生じると、光結合効率が共振周波数で振動することになり、出力光の品質を低下させてしまう。共振でミラーが傾くことは、上述した η - V特性のドリフトと等価になると考えられるので、上述の低周波信号を用いた制御方法で共振振動の影響を補償することが可能である。

[0064]

しかし、重畳する低周波信号の周波数が共振周波数より低ければ、無制御状態が生じて、制御の開始が遅れてしまう。そこで、低周波信号の周波数を共振周波数より高く設定するとともに、制御系の時定数が小さくなるように回路を構成する。これにより、高精度な制御を行うことが可能になる。

[0065]

(付記1) 印加電圧に応じて傾き角度が変化するミラーと、

前記ミラーに前記印加電圧を印加するドライバ手段と、

所定周波数の付加信号を発生する発振手段と、

前記印加電圧に前記付加信号を重畳する重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記所定周波数の信号成分を検出する検出手段 と、

検出された信号成分に基づいて前記印加電圧を制御する制御手段と

を備えることを特徴とする光スイッチ。

(付記2) 前記印加電圧に関する情報と前記光スイッチの光結合効率に関する情報のうち少なくとも一方を記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された情報を所定の通知先に通知する通知手段とをさらに備えることを特徴とする付記1記載の光スイッチ。

(付記3) 前記発振手段は、前記ミラーの機械的共振周波数より高い周波数の付加信号を発生することを特徴とする付記1記載の光スイッチ。

(付記4) 第1の印加電圧に応じて第1の方向の傾き角度が変化し、第2の印加電圧に応じて第2の方向の傾き角度が変化するミラーと、

前記ミラーに前記第1の印加電圧を印加する第1のドライバ手段と、

前記ミラーに前記第2の印加電圧を印加する第2のドライバ手段と、

第1の周波数の第1の付加信号を発生する第1の発振手段と、

第2の周波数の第2の付加信号を発生する第2の発振手段と、

前記第1の印加電圧に前記第1の付加信号を重畳する第1の重畳手段と、

前記第2の印加電圧に前記第2の付加信号を重畳する第2の重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記第1および第2の周波数の信号成分を検出 する検出手段と、

検出された第1の周波数の信号成分に基づいて前記第1の印加電圧を制御する 第1の制御手段と、

検出された第2の周波数の信号成分に基づいて前記第2の印加電圧を制御する 第2の制御手段と

を備えることを特徴とする光スイッチ。

(付記5) 第1の印加電圧に応じて第1の方向の傾き角度が変化し、第2の印加電圧に応じて第2の方向の傾き角度が変化する前段のミラーと、

第3の印加電圧に応じて第3の方向の傾き角度が変化し、第4の印加電圧に応じて第4の方向の傾き角度が変化する後段のミラーと、

前記前段のミラーに前記第1の印加電圧を印加する第1のドライバ手段と、

前記前段のミラーに前記第2の印加電圧を印加する第2のドライバ手段と、

第1の周波数の第1の付加信号を発生する第1の発振手段と、

第2の周波数の第2の付加信号を発生する第2の発振手段と、

前記第1の印加電圧に前記第1の付加信号を重畳する第1の重畳手段と、

前記第2の印加電圧に前記第2の付加信号を重畳する第2の重畳手段と、

前記後段のミラーに前記第3の印加電圧を印加する第3のドライバ手段と、

前記後段のミラーに前記第4の印加電圧を印加する第4のドライバ手段と、

第3の周波数の第3の付加信号を発生する第3の発振手段と、

第4の周波数の第4の付加信号を発生する第4の発振手段と、

前記第3の印加電圧に前記第3の付加信号を重畳する第3の重畳手段と、

前記第4の印加電圧に前記第4の付加信号を重畳する第4の重畳手段と、

前記後段のミラーで反射された光から前記第1、第2、第3、および第4の周 波数の信号成分を検出する検出手段と、

検出された第1の周波数の信号成分に基づいて前記第1の印加電圧を制御する 第1の制御手段と、

検出された第2の周波数の信号成分に基づいて前記第2の印加電圧を制御する 第2の制御手段と、

検出された第3の周波数の信号成分に基づいて前記第3の印加電圧を制御する 第3の制御手段と、

検出された第4の周波数の信号成分に基づいて前記第4の印加電圧を制御する 第4の制御手段と

を備えることを特徴とする光スイッチ。

(付記6) 印加電圧に応じて傾き角度が変化するミラーを有する光スイッチの ための制御装置であって、

前記ミラーに前記印加電圧を印加するドライバ手段と、

所定周波数の付加信号を発生する発振手段と、

前記印加電圧に前記付加信号を重畳する重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記所定周波数の信号成分を検出する検出手段 と、

検出された信号成分に基づいて前記印加電圧を制御する制御手段と を備えることを特徴とする制御装置。

(付記7) 第1の印加電圧に応じて第1の方向の傾き角度が変化し、第2の印加電圧に応じて第2の方向の傾き角度が変化するミラーを有する光スイッチのための制御装置であって、

前記ミラーに前記第1の印加電圧を印加する第1のドライバ手段と、

前記ミラーに前記第2の印加電圧を印加する第2のドライバ手段と、

第1の周波数の第1の付加信号を発生する第1の発振手段と、

第2の周波数の第2の付加信号を発生する第2の発振手段と、

前記第1の印加電圧に前記第1の付加信号を重畳する第1の重畳手段と、

前記第2の印加電圧に前記第2の付加信号を重畳する第2の重畳手段と、

前記ミラーで反射された光から前記第1および第2の周波数の信号成分を検出 する検出手段と、

検出された第1の周波数の信号成分に基づいて前記第1の印加電圧を制御する 第1の制御手段と、

検出された第2の周波数の信号成分に基づいて前記第2の印加電圧を制御する 第2の制御手段と

を備えることを特徴とする制御装置。

(付記8) 第1の印加電圧に応じて第1の方向の傾き角度が変化し、第2の印加電圧に応じて第2の方向の傾き角度が変化する前段のミラーと、第3の印加電圧に応じて第3の方向の傾き角度が変化し、第4の印加電圧に応じて第4の方向の傾き角度が変化する後段のミラーとを有する光スイッチのための制御装置であって、

前記前段のミラーに前記第1の印加電圧を印加する第1のドライバ手段と、

前記前段のミラーに前記第2の印加電圧を印加する第2のドライバ手段と、

第1の周波数の第1の付加信号を発生する第1の発振手段と、

第2の周波数の第2の付加信号を発生する第2の発振手段と、

前記第1の印加電圧に前記第1の付加信号を重畳する第1の重畳手段と、

前記第2の印加電圧に前記第2の付加信号を重畳する第2の重畳手段と、

前記後段のミラーに前記第3の印加電圧を印加する第3のドライバ手段と、

前記後段のミラーに前記第4の印加電圧を印加する第4のドライバ手段と、

第3の周波数の第3の付加信号を発生する第3の発振手段と、

第4の周波数の第4の付加信号を発生する第4の発振手段と、

前記第3の印加電圧に前記第3の付加信号を重畳する第3の重畳手段と、

前記第4の印加電圧に前記第4の付加信号を重畳する第4の重畳手段と、

前記後段のミラーで反射された光から前記第1、第2、第3、および第4の周波数の信号成分を検出する検出手段と、

検出された第1の周波数の信号成分に基づいて前記第1の印加電圧を制御する 第1の制御手段と、

検出された第2の周波数の信号成分に基づいて前記第2の印加電圧を制御する 第2の制御手段と、

検出された第3の周波数の信号成分に基づいて前記第3の印加電圧を制御する 第3の制御手段と、

検出された第4の周波数の信号成分に基づいて前記第4の印加電圧を制御する 第4の制御手段と

を備えることを特徴とする制御装置。

[0066]

【発明の効果】

本発明によれば、フォトニックネットワークで用いられる光MEMSスイッチ において、光結合特性の劣化を補償することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の光スイッチの原理図である。

【図2】

n-V特性を示す図である。

【図3】

正方向のドリフトを示す図である。

【図4】

負方向のドリフトを示す図である。

【図5】

第1の光スイッチの構成図である。

【図6】

第1の光スイッチの回路図である。

【図7】

第2の光スイッチの構成図である。

【図8】

第2の光スイッチの回路図である。

【図9】

第3の光スイッチの構成図である。

【図10】

第4の光スイッチの構成図である。

【図11】

第4の光スイッチの回路図である。

【図12】

ミラーの共振振動を示す図である。

【図13】

微小ミラーを示す図である。

【図14】

1段型ミラー構成を示す図である。

【図15】

2段型ミラー構成を示す図である。

【符号の説明】

- 11 円形ミラー
- 12 電極
- 13、16、18 可動ミラー
- 14 入力ファイバ
- 15 出力ファイバ
- 17 固定ミラー
- 20 ミラー

- 21 ドライバ手段
- 22 発振手段
- 23 重畳手段
- 24 検出手段
- 25 制御手段
- 31、32、36 曲線
- 3 3 印加電圧
 - 34、35、37 出力光の信号
 - 41、42 光路
 - 43、91、92 ミラー部
 - 44 低周波検出部
 - 45、61、62、101、102、111、112 低周波重畳回路
 - 46 ドライバ回路
 - 47 制御回路
 - 48、65、66、105、106、115、116 低周波発振回路
 - 51 光カプラ
 - 52 フォトダイオード
 - 53、136 増幅器
 - 54、71、72 乗算器
 - 55、73、74 発振器
 - 56、75、76 低域通過フィルタ
 - 57、77、78 差動増幅器
 - 58、79、80 コイル
 - 59、81、82 キャパシタ
 - 63、64、103、104、113、114 ドライバ/制御回路
 - 121 デジタル制御回路
 - 122 外部記憶回路
 - 131 通信LSI
 - 132 RAM

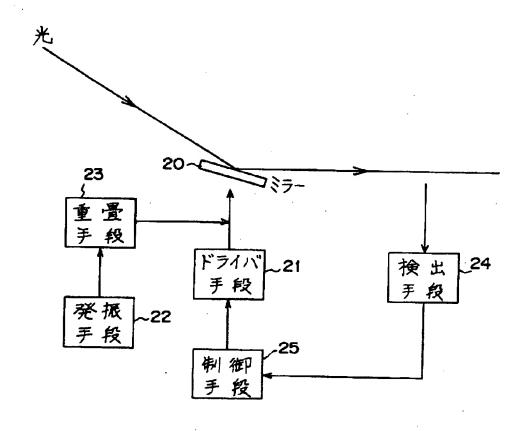
- 133 演算回路
- 134 D/A変換回路
- 135 A/D変換回路

【書類名】

図面

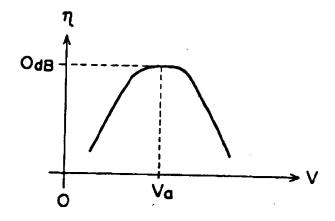
【図1】

本発明の原理図



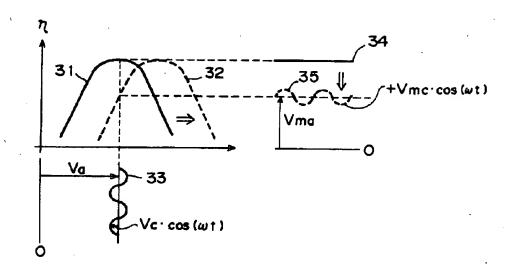
【図2】

η-ν特性を示す図



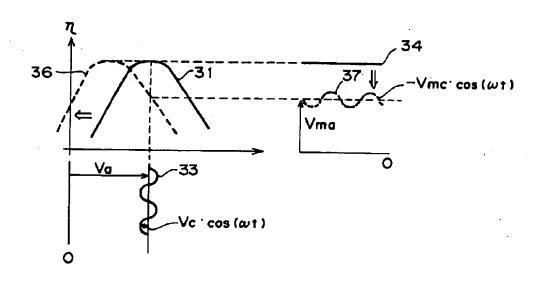
【図3】

正方向のドリフトを示す図



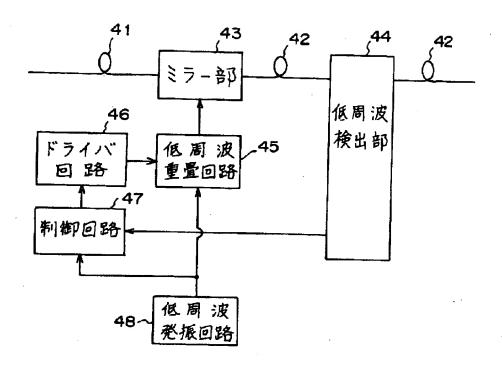
【図4】

負方何のドリフトを示す 図



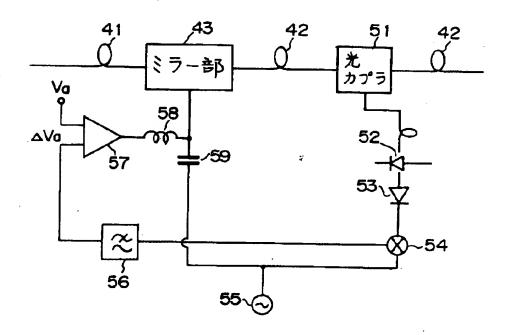
【図5】

第1の光スイッチの構成図



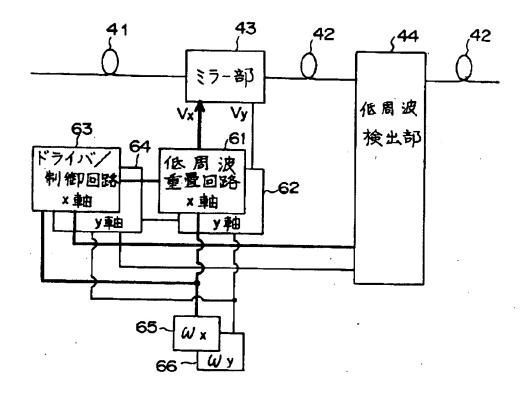
【図6】

第1の光スイッチの回路図



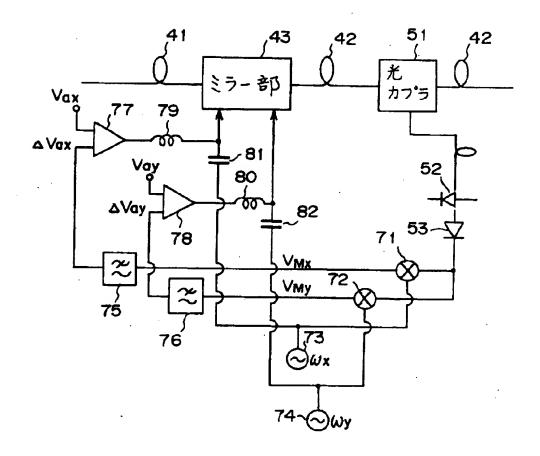
【図7】

第2の光スイッチの構成図

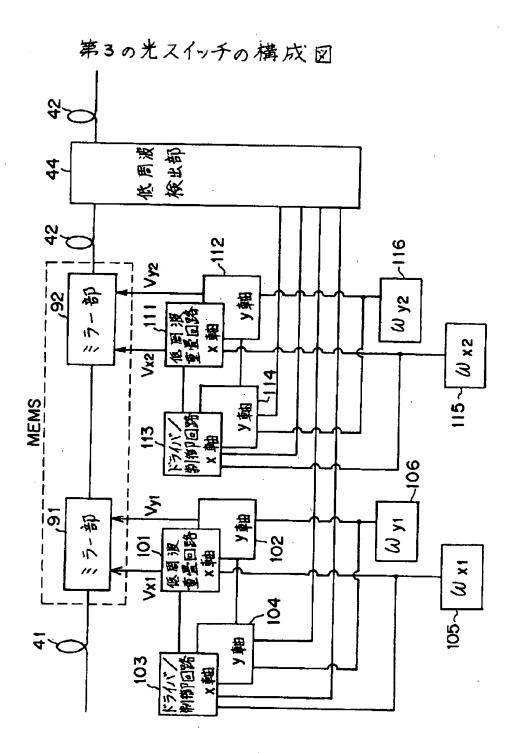


【図8】

第2の光スイッチの回路図

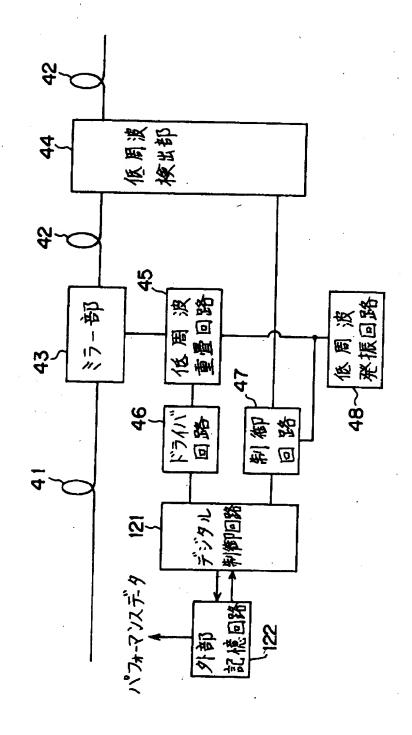


【図9】



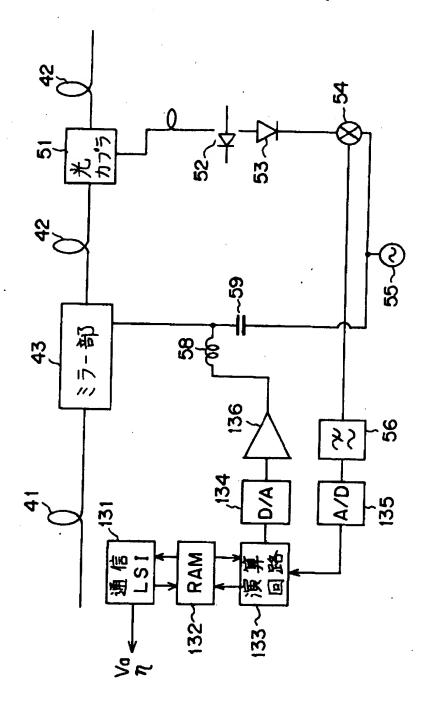
【図10】

第4の光スイッチの構成図



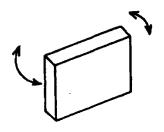
【図11】

第4の光スイッチの回路図



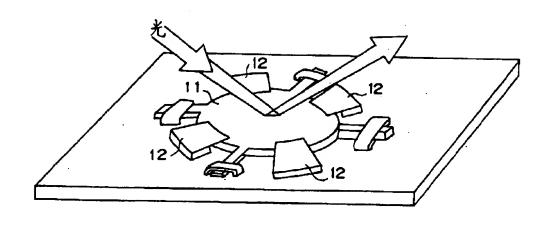
【図12】

ミラ-の共振振動を示す図



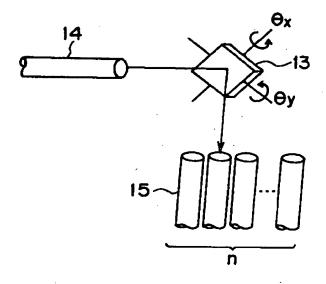
【図13】

微小ミラ-も示す図



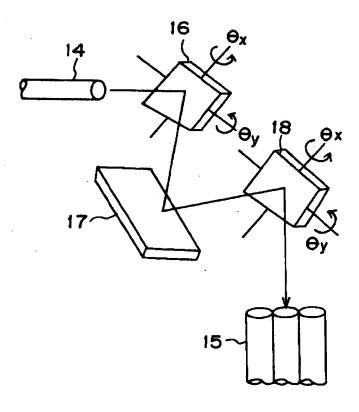
【図14】

1段型ミラ-構成を示す図



【図15】

2段型ミラー構成を示す図



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フォトニックネットワークを構成するノード装置において、光MEM Sスイッチの光結合特性の劣化を補償することが課題である。

【解決手段】 低周波重畳回路45は、ドライバ回路46からの印加電圧に、低 周波発振回路48からの低周波信号を重畳して、ミラー部43に印加する。低周 波検出部44は、ミラーにより反射された出力光から低周波成分を検出し、制御 回路47は、検出された低周波成分と低周波発振回路48の出力信号を用いて、 ドライバ回路46の出力電圧を制御する。

【選択図】 図5

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社